第３【設備の状況】

１【主要な設備の状況】

当中間連結会計期間において、連結子会社である富士通エイ・エム・ディ・セミコンダクタ㈱が、新たに当社の持分法適用会社になったFASL LLCの子会社となったため、以下の設備が、主要な設備に該当しなくなりました。

電子デバイス

会社名及び事業所名（所在地）		設備の内容	投下資本（百万円）					従業員数（人）
			土地（面積千㎡）	建物及び構築物	機械装置	その他	合計	
国内子会社	富士通エイ・エム・ディ・セミコンダクタ㈱（福島県会津若松市）	フラッシュメモリ製造設備	0（181）	23,349	62,512	1,703	87,565	1,557

（注）１．投下資本は前連結会計年度末の帳簿価額によります。ただし、建設仮勘定は除きます。
２．投下資本の機械装置には、車両及び運搬具を含みます。また、その他とは工具器具及び備品であります。
３．投下資本の土地は、すべて当社から賃貸しているものであります。

なお、ソフトウェア・サービスビジネスの新拠点として、従来の情報処理システムラボラトリ（東京都大田区）に新棟が竣工し、平成15年11月、新たに富士通ソリューション・スクエアとして事業を開始いたしました。

２【設備の新設、除却等の計画】

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はありません。また、経常的な設備の更新のための除・売却を除き、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。